патенту № ТЈ 649 при свободно вращающемся и неподвижном сепараторе.

 1,1¹ – экспериментальные данные и функциональная зависимость исправления формы шаров от продолжительности обработки при свободно вращающемся сепараторе.;

2,2¹ – экспериментальные данные и функциональная зависимость исправления формы шаров от продолжительности обработки при невращающемся сепараторе.

Литература

1. Патент № ТЈ 649, Республика Таджикистан. Устройство для центробежной абразивной обработки сферических поверхностей изделий из самоцветных камней / Т.А. Ходжаев, И.М. [и др.]. №1300825; заявл. 09.12.2013. опубл.10.11.2014. – С. 15.

2. Ходжаев Т.А. Повышение эффективности процесса изготовления шаровидных изделий из самоцветных камней совершенствованием конструкторско-технологических решений. Дис. канд. технич. наук: 05.02.07 / Т.А. Ходжаев, 2018г.

УДК 538.915

ИНЖИНИРИНГ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ В ДИХАЛЬКОГЕНИДАХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ: АВ-INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ Хорошко Л.С., Баглов А.В.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Минск, Республика Беларусь

Введение. Для создания новых электронных приборов и структур требуются перспективные материалы, среди которых часто выделяют графитоподобные гетерогенные двумерные полупроводниковые дихалькогениды и диселениды тугоплавких металлов – MoS₂, MoSe₂, WS₂ и WSe₂. Данные халькогениды могут быть сформированы как в виде многослойных материалов с различным числом, так и виде монослоя, что позволяет применять их для изготовления, например, маломощных полевых транзисторов [1] и логических схем [2]. Используя сочетание монослоев WSe₂ и MoS₂ авторы [3] экспериментально продемонстрировали двухзатворную приборную структуру. Показано, что структура может вести себя как диод Эсаки с отрицательным дифференциальным сопротивлением, как обратный диод с большим туннельным током обратного смещения или прямой выпрямительный диод с низким током обратного смещения. Подобные двумерные слоистые системы могут быть созданы путем послойного наложения уже сформированных мономолекулярных слоев, а также путем их послойного химического осаждения из газовой фазы [4]. Однако совокупность имеющихся экспериментальных и теоретических данных не позволяет однозначно определить причины сужения запрещенной зоны в гетероструктуре WSe₂/MoS₂.

В данной работе представлены результаты моделирования объемного MoS₂, объемного WSe₂, комбинированной гетероструктуры WSe₂/MoS₂, проведенного с целью установления фундаментальных электронных свойств слоистых гетерогенных двумерных кристаллов MoS₂ и WSe₂ и их взаимного влияния на ширину запрещенной зоны – энергетического зазора между валентной зоной и зоной проводимости.

Методики проведения численного моделирования. Расчет зонной структуры, парциальной плотности электронных состояний (ППЭС) и релаксацию атомов проводили в рамках теории функционала плотности и теории псевдопотенциала, реализованных в пакете OpenMX [5-8]. В гетероструктуре WSe₂/MoS₂ атомы верхнего слоя (MoS₂) располагали над атомами нижнего слоя (WSe₂) со смещением друг относительно друга аналогично тому, как это имеет место в объемном материале. В расчете использовали приближение локальной плотности и учитывали следующие электроны атомов как валентные: W - 5p, $5d \ge 6s$; Mo-4s, 4p, 4d и 5s; Se-4s и 4p; S-3s и 3p. Энергию отсечки выбирали равной 150 Ry (Ридберг), критерий сходимости расчета самосогласованного поля составлял 5·10⁻⁶ Ry, релаксацию атомов ячейки продолжали до тех пор, пока силы, действующие на атомы, становились менее 0,05 эB/Å.

Результаты и обсуждение. Результаты моделирования приведены на рис. 1.

В объемных MoS_2 и WSe_2 расстояние между атомом металла и атомом халькогена составляло 2,402 Å и 2,531 Å, соответственно. При формировании слоистого кристалла MoS_2/WSe_2 эти расстояния изменялись связь Mo - S увеличивалась до 2,438 Å при неизменной длине связи W - Se. Халькогениды молибдена и вольфрама в объемном состоянии представляют собой непрямозонные полупроводники с шириной запрещенной зоны 1,26 эВ и 1,36 эВ для MoS_2 и WSe_2 , соответственно (рис. 1 а, б). Слоистая гетероструктура WSe_2/MoS_2 демонстрирует значительно меньшую ширину запрещенной зоны, составляющую 0,22 эВ и обладает первым прямым переходом в точке K.

На рис. 2 представлены парциальные плотности электронных состоянии для структур MoS_2 , WSe_2 и WSe_2/MoS_2 .

Проведенный анализ парциальных ПЭС для исследованных структур показал, что для халькогениды молибдена и вольфрама демонстрируют схожую тенденцию: зона проводимости фомируется в большей степени вкладом атомов металла, нежели халькогена, как и область высотой 1,2 эВ до потолка валентной зоны. Более глубокие уровни валентной зоны формируются уже большим вкладом атомов халькогена.



Рисунок 1 – Зонная структура халькогенидов тугоплавких металлов в приближении локальной плотности: $a - MoS_2$; $\delta - WSe_2$; $e - WSe_2/MoS_2$

В случае гетеростуктуры WSe₂/MoS₂ резкое сужение запрещенной зоны связано с перераспределением электронов атомов молибдена и серы, которые и образуют дно зоны проводимости (рис. 2, в).

Заключение. Проведено компьютерное моделирование электронных свойств объемных халькогенидов тугоплавких металло MoS_2 , WSe_2 и гетероструктуры MoS_2/WSe_2 . Определены величины энергетических зазоров рассмотренных материалов: 1,26 эВ для MoS_2 , 1,36 эВ для WSe_2 и 0,22 эВ для WSe_2/MoS_2 . Установлено влиянии вкладов отдельных атомов структур на состояния вблизи уровня Ферми. Показано, что резкое сужение запрещенной зоны в случае гетеростурктуры обусловлено опусканием дна зоны проводимости за счет *s*- и *p*-электронов молибдена и серы. Учитывая наличие прямозонного характера гетероструктуры данный материал может быть использован для создания изделий фотоэлектроники как твердотельная альтернатива микроболометрам ближнего инфракрасного диапазона.



Рисунок 2 – Парциальные плотности электронных состояний (s+p) для исследуемых структур: $a - MoS_2$; $6 - WSe_2$; $e - WSe_2/MoS_2$

Литература

1.Radisavljevic, B. Single-layer MoS₂ transistors / B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, A. Kis // Nature Nanotechnology. 2011. Vol. 6.– P. 147–150.

2.Radisavljevic, B. Integrated Circuits and Logic Operations Based on Single-Layer MoS₂ / B. Radisavljevic, A. Radenovic, M.B. Whitwick, A. Kis // ACS Nano. 2011. – Vol. 5. – no. 12. – P. 9934–9938.

3.Liu, H.F. CVD Growth of MoS₂-based Two-dimensional Materials / H.F. Liu, S.L. Wong, D.Z. Chi // Chemical Vapor Deposition. – 2015. – Vol. 211. – no. 10-11-12. – P. 241–259.

4.Roy, T. Dual-Gated MoS₂/WSe₂ van der Waals Tunnel Diodes and Transistors / T. Roy, M. Tosun, X. Cao, H. Fang, D.-H. Lien, P. Zhao, Y.-Z. Chen, Y.-L. Chueh, J. Gu, A. Javey // ACS Nano. 2015. – Vol. 9. – no. 2. – P. 2071–2079.

5.Ozaki T. Variationally optimized atomic orbitals for large-scale electronic structures / T. Ozaki // Phys. Rev. B. 2003. – Vol. 67. – no. 15. – P. 155108.

6.Ozaki T. Numerical atomic basis orbitals from H to Kr / T. Ozaki, H. Kino // Phys. Rev. B. 2004. – Vol. 69. – no. 19. – P. 195113.

7.Ozaki T. Efficient projector expansion for the ab initio LCAO method / T. Ozaki, H. Kino // Phys. Rev. B. 2005. – Vol. 72. – no. 4. – P. 045121.

8. Reproducibility in density functional theory calculations of solids / Kurt Lejaeghere [et al.] // Science. – 2016. – Vol. 351. – Iss. 6280. – P. ad3000.